

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】令和 2 年 2 月 13 日 (2020.2.13)

【公表番号】特表 2017-528775 (P2017-528775A)

【公表日】平成 29 年 9 月 28 日 (2017.9.28)

【年通号数】公開・登録公報 2017-037

【出願番号】特願 2017-533703 (P2017-533703)

【国際特許分類】

G 0 3 F 7/20 (2006.01)

G 0 2 B 17/08 (2006.01)

【 F I 】

G 0 3 F 7/20 5 0 3

G 0 3 F 7/20 5 2 1

G 0 2 B 17/08

【誤訳訂正書】

【提出日】令和 1 年 12 月 16 日 (2019.12.16)

【誤訳訂正 1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0 0 6 6

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【 0 0 6 6 】

基板保持デバイス W S T は、z 方向と平行な（走査方向に対して垂直な）基板の制御式変位のための z 変位デバイスを含む。基板保持デバイス W S T は、像平面と平行な位置から x 方向と平行に延びる傾斜軸及び / 又は y 方向と平行に延びる傾斜角の周りにウェーハ又は基板を必要に応じて傾斜させるための傾斜デバイスを更に含むことができる。これらのデバイスは、走査中に特に事前定義可能な移動プロファイルに従って 1 つの方向に進行する走査作動の開始時点と終了時点の間の時間間隔内に基板の変位を実施することができるように動的に使用可能である。